

# 高解析掃描穿透式電子顯微鏡 TEM

## ◉ 儀器性能： 型號：JEM2100

1. 解析度：  
格子像 ( Lattice Image ) : 0.14nm  
粒子像 ( Point Image ) : 0.19nm
2. 試片座傾斜度：±25°
3. 加速電壓：80~200KV
4. 放大倍率：50~1.5M
5. 電子槍系統：LaB6 燈絲
6. 電子束直徑：最小 0.5nm

## ◉ 服務項目：

1. 材料表面組織、斷面、微細組織、晶體結構及缺陷觀察分析。
2. 全能譜定性(原子序 B5~U92)及半定量分析(含 EDS、Mapping、Linescan)。
3. 電子繞射晶像判定。
4. 數位影像系統，可作數位影像擷取及分析。

## 樣本準備需知：

### ◉ (本機台不受理磁性、高分子、有機物等樣品)

1. 粉末採用鍍碳銅網 200~300mesh, D: 3mm
2. 材料薄化者厚度 < 100nm, D: 3mm
3. 試片製作由使用者自理
4. 樣品須乾燥，在真空無揮發性

## ◉ 收費標準：

1. 影像觀察+CCD 攝影(委託操作)：5,000/時段
2. 影像觀察+CCD 攝影(自行操作)：2,000 元/時段
3. EDS(委託操作)：3,000 元/時段  
EDS(自行操作)：1,000 元/時段  
Linescan, Mapping(委託操作)：4,000 元/時段  
Linescan, Mapping(自行操作)：1,500 元/時段  
( 操作以 3 小時為一時段計 )

## ◉ 儀器負責人員連絡方式：

儀器專家：李勝隆教授 (03) 4227151#34325  
儀器專家：鄭紹良教授 (03) 4227151#34233  
技術人員：黃智詮先生 (03) 4227151#34009，allican@ncu.edu.tw

## ◉ 儀器放置地點：

中央大學工程五館 A114 室

